

## 【特許請求の範囲】

1. 成膜室に設けられた部品に対して赤外光、紫外光、可視光の少なくとも一つを照射する手段を有することを特徴とする成膜装置。
- 5 2. 成膜室の内部に設けられた部品に対して赤外光、紫外光、可視光の少なくとも一つを照射するランプ光源を有することを特徴とする成膜装置。
- 10 3. 請求項 2 において、前記ランプ光源の形状は長方形もしくは長楕円形であることを特徴とする成膜装置。
4. 成膜室に設けられた部品を輻射熱により加熱する手段を有することを特徴とする成膜装置。
- 15 5. 成膜室に設けられた部品に、該部品を輻射熱により加熱する導体が設けられていることを特徴とする成膜装置。
6. 請求項 1 において、前記部品は防着シールドであることを特徴とする成膜装置。
- 20 7. 請求項 1 において、前記成膜室に排気処理室が連結されていることを特徴とする成膜装置。
- 25 8. 請求項 7 において、前記排気処理室ではプラズマが形成されることを特徴とする成膜装置。
9. 成膜室に設けられた部品に対して赤外光、紫外光、可視光の少なくとも一つを照射することにより該部品に付着した蒸着材料を昇華さ

せる工程と、昇華させた蒸着材料を排気する工程を含む成膜装置のクリーニング方法。

10. 請求項 9 において、前記赤外光、紫外光、可視光の少なくとも一つは、前記成膜室に設けられたランプ光源を用いて照射されることを特徴とするクリーニング方法。

11. 請求項 9 において、前記赤外光、紫外光、可視光の少なくとも一つの照射面は、長方形もしくは長楕円形であることを特徴とするクリーニング方法。

12. 請求項 9 において、前記昇華工程において、前記成膜室内にハロゲン族元素を含むガスを流すことを特徴とするクリーニング方法。

13. 請求項 9 において、前記昇華させた蒸着材料は排気中にプラズマに晒されることを特徴とするクリーニング方法。

14. 請求項 13 において、前記プラズマは酸素プラズマであることを特徴とするクリーニング方法。

15. 請求項 9 において、前記蒸着材料は有機 EL 材料であることを特徴とするクリーニング方法。

16. 請求項 9 のクリーニング方法を含む電気光学装置の作製方法。

17. 請求項 9 のクリーニング方法を含む発光装置の作製方法。

18. 請求項 2 において、前記部品は防着シールドであることを特徴とする成膜装置。

19. 請求項 2 において、前記成膜室に排気処理室が連結されていることを特徴とする成膜装置。

5      20. 請求項 1 9 において、前記排気処理室ではプラズマが形成されることを特徴とする成膜装置。

21. 請求項 4 において、前記部品は防着シールドであることを特徴とする成膜装置。

10

22. 請求項 4 において、前記成膜室に排気処理室が連結されていることを特徴とする成膜装置。

15      23. 請求項 2 2 において、前記排気処理室ではプラズマが形成されることを特徴とする成膜装置。

24. 請求項 5 において、前記部品は防着シールドであることを特徴とする成膜装置。

20      25. 請求項 5 において、前記成膜室に排気処理室が連結されていることを特徴とする成膜装置。

26. 請求項 2 5 において、前記排気処理室ではプラズマが形成されることを特徴とする成膜装置。

25